

2024 半導體原子極鍍膜技術交流會暨教師研習工作坊

主辦單位：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學、財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心

課程日期：113 年 8 月 13 日(星期二)至 113 年 8 月 14 日(星期四)上午 9 點至下午 6 點

課程地點：財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心(新竹市東區研發六路20號) (課程地點如有異動，另行通知)

報名網址：<https://forms.gle/ACrBCpCLSJFzCSVS8>

參與對象：全國在職之技專校院教師、高中職教師/預計招收實體 30 人



課程內容：

日期	時間	課程單元主題/內容	授課教師
8/13 (二)	08:45-09:00	報 到	
	09:00-10:00	Sputter技術應用	台灣儀器科技研究中心 真空組 廖博輝 研究員
	10:00-12:00	ALD技術應用	台灣儀器科技研究中心 先進材料組 卓文浩 副組長
	12:00-13:30	午 餐	
	13:30-14:30	ALD實做課程/測漏 (註:分3組，一組10人)	台灣儀器科技研究中心 先進材料組-陳建霖助理工程師 周宗德助理研究員、陳建維副研究員
	14:30-15:30	ALD實做課程/Thermal ALD (註:分3組，一組10人)	台灣儀器科技研究中心 先進材料組-陳建霖助理工程師 周宗德助理研究員、陳建維副研究員
	15:30-16:30	ALD實做課程/6吋Cluster (註:分3組，一組10人)	台灣儀器科技研究中心 先進材料組-陳建霖助理工程師 周宗德助理研究員、陳建維副研究員
	16:30-18:00	產學交流時間	全體學員
8/14 (三)	08:45-9:00	報 到	
	09:00-10:00	活動報到&儀科中心介紹/開場致詞	台灣儀器科技研究中心 潘正堂 主任
	10:00-11:00	先進半導體科技發展的挑戰：從技術到人才 Challenges in Advanced Semiconductor Development: from Technology to Talents	台灣積體電路製造 張孟凡 技術研究處 處長
	11:00-12:00	高密度電漿鍍膜技術發展與應用 The Development and Application of High Power Impulse Magnetron Sputtering	台灣儀器科技研究中心 廖博輝 研究員
	12:00-13:30	午 餐	

日期	時間	課程單元主題/內容	授課教師
	13:30-14:30	極薄半導體的新進展 Emerging Atomically-Thin Semiconductors	國立陽明交通大學 連德軒 助理教授
	14:30-15:30	半導體元件邁向奈米領域所需的 原子級鍍膜前驅物 ALD Precursor for Advancing Semi in Angstrom Era	美商英特格有限公司台灣分公司 葉澤安 技術應用處長
	15:30-16:30	低損傷材料分析技術 Low Damage Material Analysis Technology	汎銓科技股份有限公司 總研發處 黃邦浩副總經理
	16:30-18:00	研發成果展示與產學交流	全體學員

★主辦單位保留報名名額資格審核權，以及修改、變更活動內容及額滿截止報名之權利。

課程聯絡人：

教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學

1.賴專員、Tel：(02)2771-2171 分機 6020、E-mail：lks@mail.ntut.edu.tw

2.鄭經理、Tel：(02)2771-2171 分機 6012、E-mail：clcheng@ntut.edu.tw